

Niskociśnieniowy system plazmowy V55-G

Standardowy system do czyszczenia, aktywacji, trawienia lub powlekania

System jest zintegrowany w 19-calowej szafie rack, która jest wyposażona w rolki i nóżki o regulowanej wysokości.

System może być stosowany do obróbki powierzchni metodami czyszczenia, aktywacji, trawienia i powlekania

Cechy systemu

- Port USB
- Interfejs Ethernet
- Zdalna konserwacja (VPN)
- Złącze mikrofalowe od góry
- Drzwi wahadłowe

Opcje

- Pompa próżniowa
- Pułapka ozonowa
- Maksymalnie dwa dodatkowe wloty gazu
- Dodatkowe częstotliwości wzbudzenia (40 kHz, 13,56 MHz)
- Bęben obrotowy do obróbki materiałów sypkich
- Stół obrotowy
- Wysuwany stół
- Automatyczne otwieranie drzwi
- Miękki start i powolne odpowietrzanie



System standardowo wyposażony jest w drzwi wahadłowe. Opcjonalnie dostępne są drzwi przesuwne.

Dane techniczne

Wymiary systemu (szer. x gł. x wys.): 670 x 900 x 1,850 mm

Wymiary komory (szer. x gł. x wys.): 400 x 460 x 340 mm

Częstotliwość wzbudzenia plazmy: Mikrofałe (2.45 GHz)

Moc mikrofał: 100-1,200 W

Wloty gazu z regulatorem masowego przepływu: 2 kanały

Zasilanie: 230/400 V, 50 / 60 Hz

Pobór mocy: 2,2 kVA

Wakuometr: Baratron

PiNK GmbH Thermosysteme

Am Kessler 6
97877 Wertheim
Germany

T +49 (0) 93 42 919 - 0
F +49 (0) 93 42 919 - 111
plasma - finish@pink.de
www.pink.de

Zmienny standardowy system V55-G charakteryzuje się dużą elastycznością obsługi procesu dzięki dwóm kanałom gazowym i trzem opcjonalnym częstotliwościom generowania plazmy

